

公開番号 又は 特許番号	特開 2014-52237
発明名称	ガスセンサ、ガス測定装置、及びガスセンサの製造方法
出願人 又は 権利者	セイコーインスツル株式会社、国立大学法人東京大学
想定デバイス	環境物質高感度センサ、環境物質センシングテープ、アンビエントデバイス
要約	<p>【利用分野】 特定のガスを選別的に測定することができるガスセンサを提供することである。</p> <p>【発明の内容】 支持基板 10 と、支持基板上に間隔をあけて向かい合うように配設された一対の金属電極 15 と、一対の金属電極間に架橋されるように形成され、半導体性の複数のカーボンナノチューブ 21 同士が集合したナノチューブ束 20 と、を備え、カーボンナノチューブの表面には、金属材又は半導体からなるナノ粒子が生体分子を介して修飾され、生体分子は、カーボンナノチューブ及びナノ粒子に対してそれぞれ特異的に結合しているガスセンサ 2 を提供する。</p>
図面	